

Solutions for Innovation

1)



形態観察・表面分析装置編 XRF / XPS / EPMA / AES / SEM / TEM / CP / FIB

化学分析装置編 GC-MS / NMR

製造装置編 巻取式電子ビーム蒸着装置 / ナノ粒子合成用高周波誘導熱プラズマ装置

JEOL Ltd. 日本電子株式会社

# LBnote

### はじめに

リチウムイオンバッテリー(LIB)の用途は携帯やパーソナルコンピュータの電源から自動車の 電源へと用途が広がり、より高い性能(出力、安定性・・・・)と安全性が求められるように なりました。このLIB の性能、品質向上には各種の高性能な評価装置を連携した解析 / 評価が 必要となります。日本電子ではマクロからナノスケールの幅広い形態観察、表面分析装置、分子 レベルで構造解析を行う化学分析装置そして高性能な膜形成や粉体形成を行う製造装置のライン アップを揃え LIB の新技術開発、品質向上を支援しています。本 LIBnote は装置導入を検討さ れている研究者、技術者の方々へソリューションを提供するものです。

### INDEX

はじめに		P01
リチウムイオンバッテリーの基	基本構造と製造工程	P02
1. 形態観察·表面分析装置編	1-1.装置選択のための特徴・紹介	P03
	1-2. エネルギー分散形蛍光 X 線分析装置 (XRF: X-ray Fluorescence Spectrometer)	P04
	1-3. 光電子分光装置 (XPS: X-ray Photoelectron Spectrometer)	P05
	1-4. 電子線マイクロアナライザ (EPMA:Electron Probe Micro Analyzer)	P07
	1-5. オージェ電子分光装置 (AES:Auger Electron Spectrometer)	P09
	1-6. 走査電子顕微鏡 (SEM: Scanning Electron Microscope)	P11
	1-7. 透過電子顕微鏡 (TEM:Transmission Electron Microscope)	P17
	1-8. 試料作製装置 (CP: Cross section Polisher, FIB: Focused Ion Beam system)	P18
2. 化学分析装置編	2-1. ガスクロマトグラフ質量分析計 (GC-MS)	P20
	2-2. 核磁気共鳴装置 (NMR:Nuclear Magnetic Resonanse)	P21
3. 製造装置編	3-1. 巻取式電子ビーム蒸着装置	P23
	3-2. ナノ粒子合成用高周波誘導熱プラズマ装置	P24
おわりに	リチウムイオンバッテリーの分析項目と適応する当社の装置	P25

### リチウムイオンバッテリーの基本構造と製造工程





材料、評価目的に応じた装置選択の目安となる表を以下に示します。表 1 はそれぞれの装置の特徴、2 ではより 具体的な装置の特性比較を表しています。

#### Liイオンバッテリー開発をサポートする装置の特徴紹介1



EDS: エネルギー分散形 X線分光装置 EELS:電子エネルギー損失分光装置 WDS:波長分散形X線分光装置 デプスプロファイル: Ar イオンにより表面をエッチングしながら分析する機能

#### Liイオン電池開発をサポートする装置の特徴紹介2

	雰囲気	励起源	主な検出信号	試料形態	分解能の目安	元素分析能力				
装置						分析深さ	検出元素範囲	エネルギー分解能	*3 検出濃度限界	
XRF	真 空 大 気	X 線	蛍光 X 線	バルク 液 体	1~12mmΦ (分析範囲)	1 mm *3	Na $\sim$ U	約150eV (Mn Kα)	数 ppm $\sim$	
XPS	真空	X 線	光電子	バルク	30 µm以下 (分析範囲)	6 nm	Li ~ U	約 0.1 eV	約 0.1 % ~	
EPMA	真空	電子線	二次電子 反射電子 特性 X 線	バルク	*1 0.1∼1µm	lμm	*2 Be ~ U	約10eV	数 10 ppm ~	
AES	真空	電子線	オージェ 電子 二次電子	バルク	*1 3 nm(二次電子像) 8 nm(オージェ分析)	6 nm	Li ~ U	約 0.1 eV	約 0.1 %~	
SEM	真空	電子線	二次電子 反射電子	バルク	*1 1.2 nm ~	lμm	B~U	約 130 eV	約0.1%~	
			特性 X 線 透過電子		*1	100	s B∼U 5 B∼U	約 10 e V 約 130 e V	数 IUppm~ 約01%~	
TEM	真空	電子線	特性X線	薄膜	0.1 nm ~	100 nm (試料厚)	B H~U	1.0 eV(Schottky)*4 0.50 eV(Cold-FEG)*4	約0.1%~	

\*1:レンズ、電子銃、条件などにより異なります \*2:Be分光用オプション分光素子を装着した場合 \*3:試料、条件により異なります \*4:使用状況により異なります 詳細は各装置のカタログ、技術資料をご参照ください

# 1 \_ \_ \_ エネルギー分散形蛍光 X 線分析装置 (XRF)

蛍光X線分析装置はX線を試料に照射することにより、放出された蛍光X線から元素の種類とその濃度を分析する 装置です。おもな活用分野は金属等の鋼種判定、原料成分の管理、RoHS(Cd,Pb,Hg,Cr,Br)、などです。試料処理 から結果が出るまでの時間が非常に短く迅速な分析に対応できます。



エネルギー分散形蛍光 X 線分析装置 JSX-1000S "ElementEye"

#### 微量金属元素の分析に優れている!

- ・分析元素:Na ~ U
- ·分析領域:1  $\sim$  12 mm $\phi$
- ・試料状態:固体・粉体・液体
- ・非破壊分析
- ・検出下限:数 ppm ~



### 正極材の分析例(粉末試料を錠剤成形)

リチウムイオンバッテリーに用いられる粉末試料を錠剤成形し、30秒間測定を行うだけで、元素組成の定量的評価を行う ことができました。今回の結果では Mn:Co:Ni を 1:1:1 で混成した試料が想定通りに調合されていることがわかりました。





【測定条件】 管電圧 : 50 kV コリメータ : 1.0 mm Ø 雰囲気 : 大気 測定時間 : 30 秒



成分	質量%	Atomic %
Mn	16.1	7.3
Со	16.9	7.1
Ni	16.4	7.0
バランス	50.6	78.6

定量結果 Mn: Co: Ni = 1: 1: 1



XPS は X 線により励起された光電子を直接観察するため、表面敏感、高エネルギー分解能、全ての固体の分析が可能という特長を持ちます。そのため、LIB 分析において重要な Li の検出や化学結合状態の分析などが可能となります。またデプスプロファイルにより最表面だけでなく、試料内部の分析も可能となります。



#### Li を直接検出できる!

- ・分析元素:Li~U
- ·表面分析装置(検出深さが約6nm)
- ・化学結合状態分析が可能
- ・検出できる元素は Li から U
- ・検出下限は約 0.1 %
- ・デプスプロファイル可能

### 分析例

### 光電子イメージ、化学結合状態分析



・Liイオンバッテリー負極の光電子イメージ(左)

ステージスキャン方式により最大50mm×18mm までの広域イメージを取得することができます。 光電子イメージ測定を行うことにより光学情報では 判別できない試料汚染や化学結合状態の違いによる 濡れ性が異なる場所の特定などに有効な機能です。

#### ・ピーク位置の違いにより化学結合状態を同定

化学結合状態の変化はピーク位置の違いに現れるため、ピーク位置を読むことにより Liの化学結合状態についても同定することができます。



金属リチウム







### デプスプロファイル、充放電後の負極材分析

#### ・正極材の深さ方向分析の例

写真左はリチウムイオンバッテリー正極の原料となる粉末を、錠剤成形したものです。デプスプロファイル測定を行うと、右のグラフのように表面 30 nm 程度の領域において Li が偏析している様子が観察されました。



分析径:1mm¢



#### ・充放電後の負極材分析

下のグラフは負極材の定性分析結果です。Liが検出されています。また、本来負極に存在しないCoが検出されています。



負極材中の Co スペクトル(下左)と Co 単体や Co 酸化物の標準試料のスペクトル(下右)とを比較すると、スペクトル形状から容易に、負極材中に存在する Co は金属状態として存在していることがわかります。正極の Co がイオン化し、負極へ移動した後に金属 Co として析出したことが推測できます。







電子線を励起源に用いた EPMA は最大 5 チャンネルの WDS を備え高いエネルギー分解能で微小領域の元素分析 が可能です。また、SEM としての能力も高く二次電子像、反射電子像による表面形態観察を併せた分析が可能に なります。





フィールドエミッション電子プローブマイクロアナライザー JXA-8530F

#### WDS と EDS の比較



WDS(波長分散型 X 線分光)の原理

EDS(エネルギー分散型 X 線分光装置)



EDS(エネルギー分散型 X 線分光)の原理



WDSとEDSは検出原理や構造が大きく異な ります。発生した特性X線を同時に検出する EDS(左下)に対して、WDSは分光素子により 分析対象元素の特性X線のみを検出します。 右上図はSi酸化物、Ta酸化物の多層膜をEDS、 WDSで比較分析した結果を示します。EDSでは SiとTaのピークが重なるのに対して、WDSで はSiとTaのピークが分離されておりWDSの 方が高いエネルギー分解能で分析が可能であるこ とが分かります。



#### 正極材の定性分析、広領域の分析

右下のスペクトルは充放電後の正極材に含まれる Co と F について定性分析を実施した結果です。EDS では、エネル ギー分解能が低くバックグラウンドが高いという点から、F-Kα線が Co の影響を受け、ピークの検出が難しくなっ ています。WDS では、Co-Lα線の影響を受けることなく、F-Kα線が検出できています。



正極材: LiCoO<sub>2</sub>、LiMn<sub>2</sub>O<sub>4</sub>、LiFePO<sub>4</sub>など 負極材: C、Si、SnO<sub>2</sub>など 電解質: LiPF<sub>6</sub>、LiClO<sub>4</sub>など



右図は、多くの充放電を繰り返したLiイ オンバッテリー正極材断面のWDSによる 元素マップ例を示しています。中心部分の 集電体 (AI) から離れるにつれ、F、C の信 号強度が高くなっています。

元素マップ中のプロファイルは、縦方向の 信号強度を平均化したものです。本来、均 ーであるはずの元素分布に偏りがみられる ことが、電池性能劣化の原因の一つと考え られます。

元素分布の僅かな変化を確認できることが
 EPMAの代表的な特徴の一つです。
 分析領域は 180 µm x 180 µm です。



# 1 \_ \_ \_ オージェ電子分光装置 (AES)

オージェ電子分光法は XPS と同様に、Li を直接検出することができる分析法の一つです。オージェ電子分光法で は電子線を励起源に用いていることから高い空間分解能も兼ね備えています。正極材 1 粒子中の Li の分布もとら えることができます。



フィールドエミッションオージェマイクロプローブ JAMP-9510F

#### Li を直接検出できる!

- ・オージェ分析の空間分解能:8nm
- ・エネルギー分解能:0.05%~0.6%で可変
- ・分析範囲:大形試料ステージにより最大 95 mmΦ
- ・中和銃と試料傾斜法で絶縁物分析が可能
- ・豊富なオプション (BEI、EBSD など)
- ・デプスプロファイル可能

#### Li の感度

JAMP-9510Fは静電半球形アナライザを採用しているため、Liのような低エネルギー領域にあるピークも高精度・高感度かつ、高エネルギー分解能で取得することができます。右図はLi、Li<sub>2</sub>0、Li<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>の各標準試料をJAMP-9510Fで測定した結果です。それぞれの化学結合状態ごとに、ピーク位置、ピーク形状がともに変化している様子が見られます。

#### ・正極材粒子中の Li オージェマップ

オージェ電子分光装置は電子線を励起源として用いているため、二次電子像 や反射電子像に対応した微小領域での元素マッピングを得ることができます。

Ιi









#### 他の分析法との比較 (Li の感度、定量)

#### ・Li の感度

オージェ電子分光法 (AES) における Li の感度は、X 線光電子分光法 (XPS) に比べて高くなります。AES と XPS とで、C の感度が同程度だと仮定し、C のピーク強度を基準に金属 Li のピーク強度の大きさを比較すると、AES の方が XPS よりも 70 倍程度高いピークが得られます。



AES における同条件で測定した Li と C のピーク強度の比較



#### ・他の分析法との定量値比較

Li を含む正極材粒子 (NMC 粒子) を使って、各種分析法における定量分析結果を下表に示します。表面から分析しても、 CP 断面での分析をしても、AES における絶対強度定量の値は他の分析法と比べても、その差は数 % 程度であり、 遜色ない定量精度が得られます。

			表面分析			炭素を除く	く、原子濃度	を規格化
				Li	0	Mn	Со	Ni
A REAL PROPERTY AND A REAL PROPERTY A REAL PROPERTY AND A REAL PRO			AES(50 µm¢ の平均)	19.6	55.0	8.5	8.5	8.4
12 Co Min 12 121	$\rightarrow$	30./tm	XPS(3mmゆの平均)	14.8	60.5	7.4	8.1	9.2
		98 - S.	バルク分析			出表を除い	/ 百子漕座	を担め化
	$\rightarrow$			Li	0	Mn	Co	Ni
		Qosso Pe	AES	5.1	53.8	13.6	14.4	13.1
A COLOR OF MERCEN			SEM-EDS	-	64.8	11.0	12.1	12.1
実験に用いた NMC 粒子 (Mn : Co : Ni = 1:1:1)		00000	XRF	-	59.8	13.1	13.7	13.4

# 1 \_ \_ 走査電子顕微鏡 (SEM)

SEM は試料最表面の微細構造観察に優れた装置です。素材観察や充放電を繰り返した電極材料の微細構造変化を 捉える装置として威力を発揮します。SEM は電子銃やレンズの方式により分解能などの機能が大幅に異なります。 ここでは最新の SEM である JSM-7800F の基本技術、応用について紹介します。JSM-7800F は電磁場重畳 型のスーパーハイブリッドレンズ (SHL) を採用しており、レンズ磁場の影響がほとんどないアウトレンズ感覚で 使える高分解能 SEM です。各種検出器そして試料バイアスを印加することにより高い分解能を得ることができる ジェントルビームモードなど最新の技術が盛り込まれたショットキー形電子銃搭載の FE-SEM です。



#### 特 徴 …………………………………………………………

- ・インレンズショットキー電子銃
- ・スパーハイブリッドレンズと TTL 検出器
- ・試料バイアス (ジェントルビーム:GB)
- ・豊富なオプション (EDS、WDS、EBSD など)

ショットキー電界放出形走査電子顕微鏡 JSM-7800F

#### 各種検出器の配置

#### ・各種検出器

下図にJSM-7800Fに構成される検出器の配置を示します。SHL とこれらの検出器を組み合わせることにより試料から発生するさまざまな情報を選別して検出できるようになります。

#### UED (Upper Electron Detector)

低エネルギーの二次電子から高エネルギーの反射電子まで幅広 く検出できます。UED下部の電極グリッドに印加する電圧を 調整することで二次電子主体の像や反射電子主体の像まで信号 選別ができます。

#### USD (Upper Secondary Electron Detector)

UED 下部のグリッド電圧で排除された二次電子を検出します。 UED で反射電子像、USD で二次電子像の2種類の情報を同時に取得することができます。

#### LED (Lower Electron Detector)

幅広く SEM で使われている E-T 検出器で UED、USD とは 違い長いワーキングディスタンスで使うことができます。低角 度に出射された反射電子を多く検出するため試料の凹凸形状を 反映した SEM 像になります。

#### BED (Retractable Backscattered Electron Detector)

半導体検出器でおもに反射電子像を得るための検出器です。





#### ジェントルビーム (Gentle Beam:GB) モードの原理

Gentle Beam(GB) モードは、試料にバイアスを印加することにより電子プローブが高い加速電圧で対物レンズを通 過した後、試料到達時に減速されるモードです。極低加速電圧で高い分解能を得るために有効な手法です。



通常の試料バイアスなしの場合(左)とGBモードの場合(右)の低加速電圧の分解能の比較をしています。試料は、カー ボン上の金粒子です。左が試料バイアスなしで加速電圧 500 V で金粒子を観察した像です。右の GB モードの場合 の方が、明らかに像がシャープで細かい粒子がはっきりとみえていることがわかります。

加速電圧:500V(GBモードなし、試料バイアスなし)



試料:カーボン上の金粒子



SEM は様々なバッテリー材料の形態観察に適しています。いくつかの例を紹介します。



セパレータ(ポリエチレン)

導電助剤(アセチレンブラック)





正極活物質:LiCoO<sub>2</sub>



正極活物質:LiMn<sub>2</sub>O<sub>4</sub>(Spinel)



#### 検出器の違い、極低加速電圧での EDS 分析

#### ・Li イオンバッテリー正極材(低加速電圧での表面凹凸と組成情報の同時取得)

最新 SEM の JSM-7800F は各種検出器を使い分けることにより試料最表面の色々な情報を得ることができます。 下の2枚の写真はリチウムイオンバッテリー正極をUSD(左)とUED(右)で同時観察した例です。USDではおも に試料表面の凹凸情報が得られており、UED では試料の組成情報が得られています。



USD: 表面情報(主に凸凹情報)

UED: 組成情報



試料:Liイオンバッテリーの正極材(加速電圧:1kV 照射電流:15nA)

2µm

2µm

1. 形態観察・表面分析装置編

# 1 \_ \_ \_ 走査電子顕微鏡 (SEM)

### トランスファーベッセル

トランスファーベッセルは、グローブボックスのような装置を使って不活性ガス中で試料を作製した後、それを大気にさらすことなく試料交換室に移動し、FE-SEMで観察できるようにするものです。大気に接すると急速に変質するような試料の観察 / 分析に有効です。



Fig.2 気密蓋を閉めた状態



Fig.3 気密蓋を開いた状態



試料サイズ:Φ25.4mm × 20 mmh

ています。

試料交換室の上部には Fig.1 に示すように「気密蓋脱着ツマミ」が取り付けられています。真空排気が終了したら、このツマミの先端にあるネジを気密蓋のタップにねじ込んでから引き上げます。Fig.2、3 はこの時の状態を表し

#### トランスファーベッセルによる非暴露効果

大気と反応するリチウムイオンバッテリー材料の評価には非暴露技術が不可欠です。トランスファーベッセルの効果 を示すデータを以下にご紹介します。

リチウムイオンバッテリーのLiCoO<sub>2</sub>を含む正極材料を非暴露観察後に大気暴露し、同じ場所の形態比較を行った例です。充放電なしの試料と充放電を5回行った試料の比較を行いました。非暴露観察では析出物など見られませんでしたが暴露後に同じ場所を観察すると析出物が見られます。このことからトランスファーベッセルによる非暴露効果が確認できます。

#### ・充電を一回もしていない電池

LiCoO。粒子に非暴露では見られなかった析出物が大気暴露後に部分的に現れた。



#### ・充放電を5回行った電池

一回も充電しなかった電池とは異なり大気暴露後にLiCoO。粒子全体に析出物が現れた。

#### 非暴露





大気暴露後



透過電子顕微鏡 (TEM)

リチウムイオンバッテリーの充放電に伴う原子レベルの変化を捉えようとする場合、透過電子顕微鏡 (TEM) が必 領となります。本観察方法では試料を薄膜にする必要がありますが、形態観察の他に EDS や EELS による元素分 析が可能です。特に、EELS では状態分析と Li の直接分析が可能です。

また、細く絞った電子線を面走査して透過像を得る STEM 機能の付いた装置では、試料での散乱角度の違う電 子を捉えることで BF(明視野)、ABF(環状明視野)、HAADF(環状暗視野)など、種々の像を得ることができ ます。リチウムや酸素などの軽元素の原子カラム位置を直接観察するには ABF が有効です。球面収差補正装置を 搭載した JEM-ARM200F を用いることでリチウムイオンバッテリーのより詳細なメカニズムの解明が期待され ています。JEM-ARM200Fの主な性能を表に示します。



ポールピースタイプ URP HRP 保証分解能 82 pm 100 pm STEM-HAADF 像 78 pm( 冷陰極 ) 100 pm( 冷陰極 ) TEM 像(粒子像) 110 pm 120 pm 結像系収差補正器搭載時 100 pm( 冷陰極 ) 120 pm(冷陰極) 立体角(EDS) (\*100 mm<sup>2</sup>SDD 装着時)





収差補正された STEM 装置では試料に 20 ~25 mrad の入射角で電子線が入射します。 STEM 検出器は試料を透過した電子と試料で散 乱した電子を検出します。

A 図のように入射角以下の電子を検出すると、 BF 像が得られます。B 図のように、入射角よ り大きな 50 mrad 以上の散乱電子を環状型の 検出器で検出すると、HAADF 像が得られます。 C 図のように、約10 mrad ~ 25 mrad までの 電子をビームストッパーを利用して検出器で検 出すると、ABF 像が得られます。

図は JEM-ARM200F によって得られたリチ ウムイオンバッテリーの正極材の LiMn<sub>o</sub>O<sub>4</sub>の 高分解能 STEM 像です。左に示した HAADF 像では、Mn のみが見えているのに対し、右 の ABF 像では酸素やリチウムなどの軽元素 のカラム位置を直接観察することができます。 リチウムイオンバッテリー材料の原子レベル での評価が期待されています。

STEM-HAADF 像



試料:LiMn\_o

STEM-ABF 像



O Li 00 O Mn

# 1 - 試料作製装置 非暴露冷却クロスセクションポリッシャ

試料冷却、大気非暴露機能を付加した断面加工装置(モデル名:IB-19510CP クロスセクションポリッシャ)を 紹介します。加工中の熱により変形しやすいハンダなどの低融点金属、樹脂などの低ガラス転移点材料や大気と反 応する電池材料の SEM 用断面加工に最適な装置です。



- ス、CP、SEM 間を大気非曝露で搬送可能です
- ・試料の冷却加工により熱ダメージを防ぐことができます
- ・間欠加工を組み合わせることにより熱ダメージを
   防ぐことができます



金属リチウムの加工、観察

#### 非暴露加工、観察の効果

下左は大気非暴露状態で加工した金属リチウム断面の SEM 像を示しています。一方、右は同一試料を 2 分間大気に暴した後に再度同じ場所を SEM 観察した例です。大気との反応生成物で試料全体が覆われているのが見られます。これによっても非暴露搬送の有効性が確認できます。

専用のトランスファーベッセル



大気非暴露機能で加工した結果



空気にさらして2分後に観察した結果

# 1 - 〇 試料作製装置 FIB(集束イオンビーム装置)

FIB とはイオン化された Ga を静電レンズ系で集束し、試料上を面走査する装置です。Ga のスパッタリング効果 によるボックス状の加工や、Ga 照射により発生した二次電子による画像 (SIM 像: Scanning Ion Microscope 像) 観察、さらに有機金属ガス照射によるカーボン、タングステン、白金などの成膜機能を有しています。最近では同 ーチャンバに FIB 鏡筒と SEM 鏡筒を備えたマルチビームシステムが普及しています。マルチビームシステムでは FIB で加工した面を即 SEM 観察や EDS 分析できる装置です。また、微細加工、TEM 試料作製や一定間隔で FIB 加工 /SEM 像取得を自動で繰り返し試料の立体情報を取得する三次元構造解析など幅広く利用されています。ア タッチメントとして試料冷却やトランスファーベッセル機構の取り付けも可能です。



観察の

マルチビーム装置の特徴 ………………………………………

- SEM はショットキータイプ (JIB-4601F) の電子銃
   とLaB<sub>6</sub> (JIB-4501) があります
- ・ 三次元解析は形状のみでなく、EBSD(結晶方位解析)
   や EDS(元素分析)も可能です

#### ハンダの冷却加工、三次元解析

冷却ステージを用い、鉛ハンダの加工を行った例を紹介します。上段左は25℃(室温)で断面加工した鉛ハンダの例で、 界面に空隙が生じているのがわかります。さらに三次元解析により再構成された像を見ると空隙がほぼ均一に分布して いることがわかります。一方、-50℃で加工した断面には空隙は見られません(下段左)。さらに三次元再構成像を確 認すると空隙のコントラストを確認することはできません。これらの結果、室温で加工した鉛ハンダに見られる界面の 空隙は加工による熱ダメージであることが分かります。

SIM 像

三次元再構成像



加工温度 25℃(鉛の部分をグレー、隙間の部分を白に色分け)



加工温度-50℃(隙間が見られない)

# 

ガスクロマトグラフ(GC)と質量分析計(MS)を組み合わせた GC-MS は、GC 内に設置したキャピラリーカラ ムによって成分分離した有機成分を順次 MS に導入、そして熱電子により生成したイオンを質量分析する装置です。 多成分が混合した揮発性有機化合物の分析に適した装置であり、定性分析および定量分析に広く用いられています。





### 過放電条件下でリチウムイオンバッテリー内に発生したガス

リチウムイオンバッテリーを過放電状態にしたときに発生するガス成分を、ガスクロマトグラフ四重極質量分析計で測定した例を示します。広く電解質溶媒として用いられている炭酸ジエチル(DEC, Peak No.19)や炭酸エチレン(EC, Peak No.20)が検出されたほか、低級炭化水素、フッ素化合物、シリコン化合物など、多くの成分が検出されました。



過放電条件下で Li バッテリー内に発生したガスの TIC クロマトグラム

Peak No.	成分名	Peak No.	成分名	Peak No.	成分名
1	窒素	8	2- フルオロプロパン	15	酢酸エチル
2	メタン	9	ギ酸メチル	16	ヘキサン
З	二酸化炭素	10	ジフルオロジメチルシラン	17	炭酸エチルメチル
4	フルオロエタン	11	ブタン	18	プロピオン酸エチル
5	トリフルオロメチルシラン	12	ギ酸エチル	19	炭酸ジエチル (DEC)
6	プロパン	13	エチルエーテル	20	炭酸エチレン (EC)
7	シクロプロパン	14	ペンタン		

# 

NMRは、物質中の特定の元素に注目し、その周りの 構造や環境を調べることができる手法です。特に LIB の分析においては、Li 核を直接観測できる数少ない手 法であり、正極、負極、電解質と場所を問わず、材料 中の Li の量、化学状態、運動性など、様々な情報を得 ることが出来ます。





### 超高速 MAS 測定による正極材料分析

固体 NMR は、化学状態の異なる核(イオン)を異なる信号として観測できるため、固体材料の構造や物性分析の強力なツー ルとなります。固体 NMR では、高分解能スペクトルを得るために、試料を外部磁場に対してマジック角(54.74°)傾けて 高速回転させ(Magic Angle Spinning、以下 MAS)測定を行います。しかしながら、LIB の電極では常磁性イオンの影響 で観測範囲に数多くのスピニングサイドバンド (SSB)が生じてしまい、解析が困難になります。このような試料でも 1 mm や 0.75 mmMAS プローブを用いて超高速 (~110 kHz)で回転させることで、SSB を真のピークから遠ざけることができ、 埋もれていた真のピークの判別が可能になります。下図に示した二酸化マンガンリチウムバッテリーの正極材の<sup>7</sup>Li スペクト ルでは Mn 近傍の Li が 800 ppm 付近に 2 種類、Mn から離れた Li が 0 ppm に 1 種類存在することが分かりました。



二酸化マンガンリチウムバッテリー正極材の<sup>7</sup>Li スペクトル

3.2 mm 2.5 mm 1 mm 0.75 mm

**4** mm

Magic Angle Spining

# ───── 核磁気共鳴装置 (NMR)

#### NMR による自己拡散係数測定

NMRは、磁場中の核スピンに生じるエネルギー差に相当す る電磁波の吸収・放出過程を見る装置であり、その共鳴周波 数(核スピンの歳差運動周波数)は磁場強度や核種(核磁気 回転比)に依存します。このため、勾配磁場パルスを用いる ことで試料中における原子の位置情報を得ることができ、(分 子やイオンの)自己拡散係数を求めることができます。電解 質中のイオンの自己拡散係数値はイオン伝導度との相関が強 いため、電解質の評価に用いることが出来ます。また、カチ オンとアニオンそれぞれの拡散係数を別々に求めることがで きるため、イオン伝導メカニズムに関する情報も得ることが できます。



試料位置に対する勾配磁場パルス印加時の効果



### 固体電解質中の<sup>7</sup>Li核拡散係数解析

固体電解質中のLiイオンの自己拡散係数を求めた例を紹介します。印加する勾配磁場の強度を変化させると、Liイオンから得られる信号強度は以下の式に従って減衰します(データは下左図)。

したがって、得られた信号強度をプロットすることで(下右図)、電解質中のカチオンであるLiイオンの自己拡散係数値(D = 5.6×10<sup>-11</sup> m<sup>2</sup>/s) がイオン伝導度の目安として得られました。



# 1 巻取式電子ビーム蒸着装置

幅広の金属箔やフィルムを真空中で走行させながら、電子ビーム蒸着により薄膜を形成することができる装置です。 金属、酸化物を問わず様々な無機材料を電子ビーム加熱により蒸着が可能。リチウムイオンバッテリーの電極膜形 成にも利用できます。

- ・電子ビームを高速でスキャンさせ、蒸着材料の一定の範囲に電子ビーム照射・加熱ができます
- · 高速で出力制御できるため、精密に膜厚や蒸着レートを制御することが可能です
- ・スパッタリング法やCVD法と比較し、1桁以上蒸着レートを高めることができます

・専用コントローラを用いて2元または3元の同時蒸着も対応可能です



両面蒸着仕様例



\* 1 台で 500 ~ 1,000 mm 幅へ蒸着ができます。(電子銃仕様やレイアウトにより異なります) \* 複数台の直進型電子銃を並列させることにより、1 m 幅以上のフィルムにも対応できます。

電子銃並列設置例



JEOL 直進型電子銃 (100 kW)

# 子 ー 2 ナノ粒子合成用高周波誘導熱プラズマ装置 ユーニー

高周波誘導熱プラズマは、アルゴンなどの不活性ガスに高周波電力を与え、電磁誘導により約1万度の超高温プラズマ 状態にしたものです。この高周波誘導熱プラズマ中に原料(粉体/液体/ガス)を導入し、瞬時に溶融や蒸発、反応や 分解など、急速加熱から急冷による材料プロセッシングが可能です。リチウムイオン電池の電極微粒子の改質やナノ粒 子化、複合化などに期待できます。



TP-40020NPS (6 kW 実験装置)



Ar + H<sub>o</sub> プラズマ

- 成分のまま蒸発または溶融することがで きます。高純度の材料合成が可能です。
- ・超高温のため沸点のことなる異種原料でも 瞬間的にその場でフラッシュ蒸発させる ことができます。
- ・様々なガスをプラズマ化することができ、 高ラジカルな反応場で酸化、還元、窒化、 炭化などの化学反応や改質が可能です。
- ・プラズマの先端部に基材や基板を設置し、
   成膜(プラズマ溶射)を行う事もできます。



#### 負極材料向けシリコン系ナノ粒子

Fig. 1





《利点·特徴》

- ・冶金級金属シリコン(~ 99.5%)を使用可
- ・高スループット(~ 360 g/h)
- ·高次複合構造
- (数10nmの一次粒子から構成される高次ナノ複合体) ・コアシェルや但持などの複合粒子が合成可

Fig.2





CH<sub>4</sub>添加濃度による充放電 エネルギー密度変化



コア = シリコン、シェル = カーボンの コアシェルナノ粒子

データご提供:東京大学大学院工学系研究科 マテリアル工学専攻 神原研究室 Fig.1,4: Reproduced with permission from J. Appl. Phys. 115, 143302 (2014). Copyright 2014, AIP Publishing LLC. Fig.2, 3: Sci. Technol. Adv. Mater. 15 (2014) 025006









透過型電子顕微鏡

走查型電子顕微鏡

オージェ電子分光装置

部材	分析項目	TEM	SEM	AES
正極材	形態観察	0	0	0
	元素組成分析	0	0	0
	元素分布分析	0	0	0
	結晶構造分析	0	0	
	活物質原子価特定	0		0
	集電体不動態膜分析	0		0
	化学状態分析	0		0
	バインダー定性分析			
	不純物評価			
負極材	形態観察	0	0	
	元素組成分析	0	0	0
	元素分布分析	0	0	0
	炭素結晶状態分析	0		
セパレータ	形態観察	0	0	0
	元素組成分析	0	0	0
	化学構造分析			
	熱劣化メカニズム			
電解液	成分 · 不純物分析			
	拡散係数評価			
製造雰囲気ガス	ガス組成分析			
	成分連続モニター			
全体	欠陥不良解析	0	0	0

### リチウムイオンバッテリーの分析項目と適応する当社の装置

これまで LIB の分析・評価に関して、代表的な JEOL 装置ラインナップとその特徴、および応用例を 紹介してきました。本 LIBnote では紹介できなかった目的に応じた適用装置の目安を下表に示します。 さらに詳細な用途に関してはそれぞれの装置のカタログ、仕様書などの技術資料をご参照いただくか、 弊社窓口へお問い合わせください。











電子スピン共鳴装置



電子プローブマイクロ アナライザ

Ì

Ī

X 線光電子分光装置 蛍光

蛍光 X 線分析装置

核磁気共鳴分析装置

ガスクロマトグラフ 質量分析装置

EPMA	XPS	XRF	NMR	ESR	MS
0					
0	0	0			
0	0				
				0	
0	0				
	0				
0	0		0		
			0		
				0	
0	0				
0	0				
0	0			0	
0					
	0				
			0		
				0	
		0	0		0
			0		
					0
					0
0					



このカタログに掲載した商品は、外国為替及び外国貿易法の安全輸出管理の規制品に該当する場合がありますので、輸出するとき、または日本国外に持ち出すときは当社までお問い合わせ下さい。



#### 本社・昭島製作所

本196-8558 東京都昭島市武蔵野3−1−2 TEL:(042)543−1111(大代表) FAX:(042)546−3353 www.jeol.co.jp IS0 9001 · IS0 14001 認証取得

	1001	1001 Dispit			
東京事務所 〒100-0004 東京都千代田区大手町2丁目1番1号 大手町野村ビル13階	札幌支店	〒060-0809	北海道札幌市北区北9条西3丁目19番地 ノルテプラザ5階	TEL: 011-726-9680	FAX: 011-717-7305
<b>営業企画室</b> TEL: 03-6262-3560 FAX: 03-6262-3577	仙台支店	〒980-0021	宮城県仙台市青葉区中央2丁目2番1号 仙台三菱ビル6階	TEL: 022-222-3324	FAX: 022-265-0202
電子光学機器営業推進室 TEL: 03-6262-3567 分析機器営業推進室 TEL: 03-6262-3568	筑波支店	₹305-0033	茨城県つくば市東新井18番1号	TEL: 029-856-3220	FAX: 029-856-1639
産業機器営業部 TEL:03-6262-3570 医用機器ソリューション販促室 TEL:03-6262-3571	名古屋支店	₹7450-0001	愛知県名古屋市中村区那古野1丁目47番1号 名古屋国際センタービル14階	TEL: 052-581-1406	FAX: 052-581-2887
東京支店 〒100-0004 東京都千代田区大手町2丁目1番1号 大手町野村ビル18階 TEL:03-6262-3580 FAX:03-6262-3588	大阪支店	〒532-0011	大阪府大阪市淀川区西中島5丁目14番5号 ニッセイ新大阪南ロビル11階	TEL: 06-6304-3941	FAX: 06-6304-7377
電子光学機器営業グルーブ TEL : 03-6262-3581 分析機器営業グルーブ TEL : 03-6262-3582	西日本ソリ	リューションセン	9—		
医用機器営業グループ TEL:03-6262-3583		〒532-0011	大阪府大阪市淀川区西中島5丁目14番5号 ニッセイ新大阪南ロビル1 階	TEL: 06-6305-0121	FAX: 06-6305-0105
東京第二事務所 〒190-0012 東京都立川市曙町2丁目8番3号 新鈴春ビル9階	広島支店	730-0015	広島県広島市中区橋本町10番6号 広島 NSビル5階	TEL: 082-221-2500	FAX: 082-221-3611
半導体機器営業室 TEL : 042-528-3491 ソリューションビジネス部 TEL : 042-526-5098	高松支店	〒760-0023	香川県高松市寿町1-1-12 パシフィックシティ高松5階	TEL: 087-821-0053	FAX: 087-822-0709
機浜事務所 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目6番4号 新横浜干歳観光ビル6階 TEL:045-474-2181 FAX:045-474-2180	福岡支店	7812-0011	福岡市博多区博多駅前2丁目1番1号 福岡朝日ビル5階	TEL: 092-411-2381	FAX: 092-473-1649

海外事業所・営業所 Boston, Paris, London, Amsterdam, Stockholm, Sydney, Milan, Singapore, Munich, Beijing, Moscow, Sao Paulo ほか